(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年4月28日(28.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/038078 A1

(51) 国際特許分類7:

C22C 5/06, G11B 7/24, 7/26

C23C 14/34.

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/015294

(22) 国際出願日:

2004年10月8日(08.10.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-356769

2003年10月16日(16.10,2003)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 石福金属 興業株式会社 (ISHIFUKU METAL INDUSTRY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒101-8654 東京都千代田区 内神田三 丁目20番7号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 長谷川 浩一 (HASEGAWA, Koichi) [JP/JP]: 〒340-0002 埼玉県 草加 市青柳2丁目12番30号石福金属興業株式会社 草加第一工場内 Saitama (JP). 石井 信雄 (ISHII, Nobuo) [JP/JP]; 〒340-0002 埼玉県 草加市 青柳2丁目12番 30号石福金属興業株式会社 草加第一工場内 Saitama (JP).

(74) 代理人: 小田島 平吉、外(ODAJIMA, Heikichi et al.); 〒107-0052 東京都 港区 赤坂1丁目9番15号 日本 自転車会館 小田島特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SPUTTERING TARGET MATERIAL

(54) 発明の名称: スパッタリングターゲット材

(57) Abstract: Disclosed is a sputtering target material composed of an Ag-base alloy obtained by adding a specific small amount of P to Ag for alloying. The sputtering target material has a high reflectance and excellent heat resistance.

(57) 要約: 本発明は、Agに特定少量のPを添加して合金化してなるAg基合金から構成された高い反射率を有し且つ 耐熱性に優れたスパッタリングターゲット材を提供するものである。

